" Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 09162693 PUBLICATION DATE : 20-06-97

APPLICATION DATE : 14-12-95 APPLICATION NUMBER : 07325637

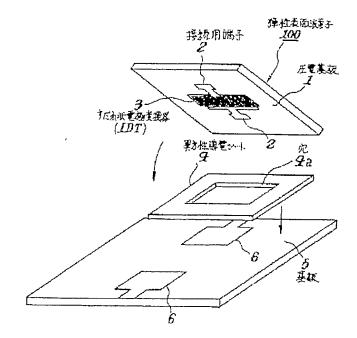
APPLICANT: KOKUSAI ELECTRIC CO LTD;

INVENTOR: ISHII AKINORI;

INT.CL. : H03H 9/25 H03H 3/08

TITLE : SURFACE ACOUSTIC WAVE

ELEMENT



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide the surface acoustic wave element in which space formation for chip exciting electrode section, airtight sealing and connection to a substrate are conducted at once while avoiding use of large-sized components and cost increase.

SOLUTION: An interdigital electrode transducer 3 and a connection terminal 2 are formed on a piezoelectric substrate 1 on which a surface acoustic wave element 100 is formed, an anisotropic conductive sheet 4 to a position of which corresponding to the interdigital electrode transducer 3 a hole 4a is made is inserted between the surface acoustic wave element 100 and the substrate 5 and the entire components are sealed airtightly by an epoxy resin. The continuity between the surface acoustic wave element 100 and the substrate 5 is taken by the anisotropic conductive sheet 4 by a compression stress when the epoxy resin is cured and a space 8 stimulating the surface acoustic wave is formed on the surface acoustic wave element 100.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-162693

(43)公開日 平成9年(1997)6月20日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
H03H	9/25		7259-5 J	H03H	9/25	A	
	3/08		7259-5 J		3/08		

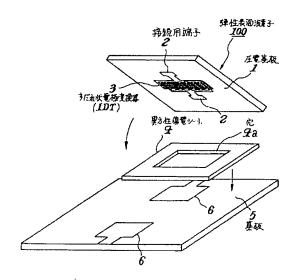
		審査請求	未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)		
(21)出願番号	特顯平7-325637	(71)出願人	000001122 国際電気株式会社		
(22)出顧日	平成7年(1995)12月14日	東京都中野区東中野三丁目14番20号			
		(72)発明者	石井 昭紀		
			東京都中野区東中野三丁目14番20号 国際		
			電気株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 石戸 元		
]			

(54) 【発明の名称】 弾性表面波索子

(57)【要約】

【課題】 部品の大型化、コスト増をおさえ、チップの 励振電極部の空間形成、気密封止、基板との接続を一挙 に行なえる弾性表面波素子を提供する。

【解決手段】 形成された弾性表面波素子100の圧電基板1上には、すだれ状電極変換器3と接続用端子2とを形成し、このすだれ状電極変換器3に対応する部分に穴4aを開けた異方性導電シート4を弾性表面波素子100と基板5との間にはさみ、全体をエポキシ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂が硬化するときの圧縮応力で弾性表面波素子100と基板5との導通を異方性導電シート4で取り、かつ弾性表面波素子100上に弾性表面波が励振可能な空間8を形成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 形成された弾性表面波素子の圧電基板上 には、すだれ状電極変換器と接続用端子とを形成し、と のすだれ状電極変換器に対応する部分に穴を開けた異方 性導電シートを弾性表面波素子と基板との間にはさみ、 全体をエポキシ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂 が硬化するときの圧縮応力で弾性表面波素子と基板との 導通を異方性導電シートで取り、かつ弾性表面波素子上 に弾性表面波が励振可能な空間を形成したことを特徴と する弾性表面波素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電極部分に弾性表 面波が励振および伝搬可能な空間を形成し、かつ基板と の接続を取るように気密封止する弾性表面波素子に関す るものである。

[0002]

【従来の技術】弾性表面波素子(共振子、フィルタ等) を他のIC回路等と同時に封止すると、樹脂が励振する 電極表面に触れるため所望の電気特性を満足することは 20 本来は圧電基板 1 の 1 / 3 0 0 以下の厚みである。 できない。図4は従来の弾性表面波素子の接続方法を示 すもので、10は弾性表面波素子の圧電基板、11はボ ンディングワイヤ、12はセラミック等のパッケージ、 13はパッケージ側電極、14は金属カバーで、圧電基 板10の励振する電極面10aを中空かつ気密にするた め、セラミック等のパッケージ12を用いて金属カバー 14の溶接により封止している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図4に示した ように、弾性表面波素子1チップを1パッケージに入れ 30 【0008】 るため、パッケージの大きさにより部品の大きさが決定 され、またパッケージ12はワイヤ11のボンドと金属 カバー14とが接触しないように十分な厚さが必要であ り、部品の小型化、薄型化にも制約があった。また、セ ラミック等のパッケージ12は高価なためにコスト増に なってしまう。したがって、従来の方法では部品の小型 化、低価格化に限度があった。本発明の目的は、かかる 従来技術の問題点であるパッケージの使用に伴う部品の 大型化、コスト増をおさえるもので、チップの励振電極 部の空間形成、気密封止、基板との接続を一挙に行なえ 40 る弾性表面波素子を提供するものである。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の課題に鑑 みなされたものであって、形成された弾性表面波素子1 00の圧電基板1上には、すだれ状電極変換器3と接続 用端子2とを形成し、このすだれ状電極変換器3に対応 する部分に穴4 a を開けた異方性導電シート4を弾性表 面波素子100と基板5との間にはさみ、全体をエポキ シ樹脂で気密に封止し、このエポキシ樹脂が硬化すると きの圧縮応力で弾性表面波素子100と基板5との導通 50 3

を異方性導電シート4で取り、かつ弾性表面波素子10 0上に弾性表面波が励振可能な空間8を形成したことを 特徴とする。

[0005]

【発明の実施の形態】図1示のように、弾性表面波素子 100の圧電基板1上に接続用端子2, すだれ状電極変 換器(Inter Digital Transducer,以下IDTと略記す る) 3で構成し、この弾性表面波素子100とガラス、 エポキシ、セラミック等の基板5との間に異方性導電シ 10 ート4をはさむ。この時、弾性表面波素子100のID T3に対応する部分に穴4 aを開けておく。この穴4 a はIDT3の面積より大きく、接続用端子2と基板側接 続用端子6が接続できれば、いかなる形状、大きさでも

【0006】図2(a)は、弾性表面波素子100と異 方性導電シート4と基板5とを重ねた状態である。図2 (b)は図2(a)のA-A線断面図である。との断面 図において、接続用端子2, 1DT3, 基板側接続用端 子6は、図面を判りやすくするために厚く表現したが、

【0007】図3は図2のものをエポキシ樹脂7で封止 した状態の断面図である。エポキシ樹脂7が硬化する時 に圧縮応力が動き、異方性導電シート4を介して接続用 端子2と基板側接続用端子6が接続される。さらに、1 DT3と基板5との間には弾性表面波素子100上に弾 性表面波が励振可能な空間8を形成し、全体は気密に封 止される。以上のようにして、この装置は弾性表面波が 励振可能な空間を持たせ、かつ気密に封止した弾性表面 波素子となる。

【発明の効果】以上のように本発明によれば、セラミッ ク等のバッケージを使用することなく電極励振部の空間 形成、気密封止、基板との接続を一度に行うことができ る。それにより、工程数の削減による大幅なコスト削減 が可能である。さらに、パッケージを使用する必要がな いので、原価低減、素子の小型化が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態の重ね合わせ前の状態の斜

【図2】(a)は本発明の一実施形態の重ね合わせ後の 状態の斜視図、(b)は(a)のA-A線断面図であ

【図3】本発明の一実施形態のエポキシ樹脂封止後の状 態の断面図である。

【図4】従来の装置におけるセラミックパッケージの構 成の断面図である。

【符号の説明】

- 圧電基板
- 接続用端子 2
- すだれ状電極変換器(IDT)

3

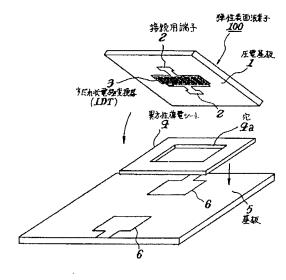
- 4 異方性導電シート
- 5 基板
- 6 基板側接続用端子

*7 エポキシ樹脂

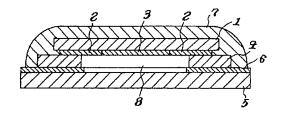
8 空間

* 100 弹性表面波素子

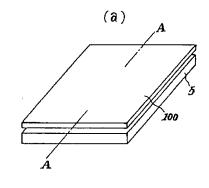
【図1】



【図3】



【図2】



(b)

2a 2 3 2 1

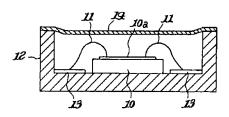
46

78

78

78

【図4】



【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成14年6月28日(2002.6.28)

【公開番号】特開平9-162693

【公開日】平成9年6月20日(1997.6.20)

【年通号数】公開特許公報9-1627

【出願番号】特願平7-325637

【国際特許分類第7版】

H03H 9/25

3/08

[FI]

H03H 9/25 A 3/08

【手続補正書】

[提出日] 平成14年3月28日(2002.3.2 8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0003

【補正方法】変更

【補正内容】

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、図4に示したように、弾性表面波素子1チップを1パッケージに入れるため、パッケージの大きさにより部品の大きさが決定

され、またバッケージ12はボンディングワイヤ11のボンドと金属カバー14とが接触しないように十分な厚さが必要であり、部品の小型化、薄型化にも制約があった。また、セラミック等のバッケージ12は高価なためにコスト増になってしまう。したがって、従来の方法では部品の小型化、低価格化に限度があった。本発明の目的は、かかる従来技術の問題点であるバッケージの使用に伴う部品の大型化、コスト増をおさえるもので、チップの励振電極部の空間形成、気密封止、基板との接続を一挙に行なえる弾性表面波案子を提供するものである。